

※課題番号 : F-12-KT-0125
※支援課題名 (日本語) : 石英基板の加工
※Program Title (in English) : Processing of Quartz Glass
※利用者名 (日本語) : 山本 和也
※Username (in English) : Kazuya Yamamoto
※所属名 (日本語) : ナルックス株式会社
※Affiliation (in English) : Nalux Co., Ltd.

※概要 (Summary) :

【相談内容】

石英基板の幅数ミクロン以下、深さサブミクロンオーダーの加工に関して最適な装置（露光装置、エッチング装置）、加工条件、構造評価方法、利用時間等々について相談を受けた。

【希望利用装置】

- ・ ステッパ
- ・ 電子ビーム描画装置
- ・ 磁気中性線放電ドライエッチング装置
- ・ 超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡

【回答】

各描画装置のパターン精度、断面形状、評価装置に関して事例をもって説明した。

【結果】

平成 24 年度は装置利用なし。

※実験 (Experimental) :

技術相談のため割愛

※結果と考察 (Results and Discussion) :

技術相談のため割愛

※その他・特記事項 (Others) :

なし